PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-246902

(43) Date of publication of application: 05.11.1991

(51)Int.Cl.

H01C 7/02 G01K 7/22

(21)Application number: 02-043746

(71)Applicant: SUMITOMO METAL IND LTD

(22)Date of filing:

23.02.1990

(72)Inventor: YAMAMOTO TOSHISHIGE

TANIMAE HIROKI

TAKAO SATORU

(54) MANUFACTURE OF POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT THERMISTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily manufacture a thermistor which has different Curie points in one part of a magnetic element body and in the other part and is free from cracks and the like, by baking a molded body of calcined powder of BaTiO3 based porcelain in an atmosphere containing the shifter element of Curie point.

CONSTITUTION: In the manufacturing method of a planar PTC thermistor which has different Curie points in one part of a magnetic element body constituting a planar part and the other part, a molded body of calcined powder of BaTiO3 based porcelain is baked in an atmosphere of Pb or the like as the shifter of Curie point; or a molded body of BaTiO3 based porcelain or a molded body of the calcined powder is baked in an atmosphere of halogen gas such as F and Cl which decrease the resistance value. By this constitution, each component in the atmosphere is subjected to vapor phase diffusion and permeates from the surface of the molded body. Hence the surface layer part and the central part of an obtained PTC thermister have different characteristics, so that a degauss element part and a heater element part are formed in a magnetic element body.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-246902

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月5日

H 01 C G 01 K 7/02

6835-5E 7267-2F Z

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

60発明の名称 正特性サーミスタの製造方法

> 顧 平2-43746 ②特

顧 平2(1990)2月23日 **22**出

@発 明 者 利 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号 住友金属工業株 山 本 番 式会补内

個発 蚏 者 前 太 基 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 住友金属工業株式 谷

@発 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号 住友金属工業株 明 者 高 尾 哲

式会补内

住友金属工業株式会社 の出 庭 人

大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号

弁理士 井内 ②代 理 人 龍二

明細書

1. 発明の名称

正特性サーミスタの製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 平板部を構成する磁器素体の一部分と他 の部分とがキュリー点を異にする平板形の正特性 (以下、PTCと記す)サーミスタの製造方法に おいて、BaTiO。系磁器の仮焼粉の成形体を キュリー点のシフタ元素を含む雰囲気中で焼成す ることを特徴とするPTCサーミスタの製造方 法.
- (2) 平板部を構成する磁器素体の一部分と他 の部分とが比抵抗を異にする平板形のPTCサー ミスタの製造方法において、BaTiO。系磁器 の成形体あるいは仮焼粉の成形体をハロゲンガス の雰囲気中で焼成することを特徴とするPTCサ - ミスタの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はPTCサーミスタの製造方法に関し、

より詳細には消磁電流の制御等に使用されるPT Cサーミスタの製造方法に関する。

従来の技術

従来この種のPTCサーミスタは、消磁電流を 制御するための消磁素子等に利用されており、第 7図は、特開昭63-58902号公報において 開示されているこの種の消磁素子30の断面図を 示している.

消磁素子30において、31は第1のPTCサ ーミスタであって、その両側面には電極32a、 32bが形成されており、キュリー点は50℃に設 定されている。PTCサーミスタ31の側方には 第2のPTCサーミスタ33が並設され、第2の PTCサーミスタ33の両側面には電極34a、 3.4 bが形成され、キュリー点は120 ℃に設定さ れている。そして、相対向する電極面32bと 34 a との間にはリード端子35 が介装され、半 田38で固着されている。また、PTCサーミス タ31の別の電極面32aにはリード端子36 が、PTCサーミスタ33の別の電極面34bに

はリード端子37がそれぞれ半田38によって固 着されている。そして、これら2個のPTCサー ミスタ31、33は外周部を絶縁性の樹脂39に よって覆われている。

第8図は、上記構成の消磁素子の一使用例を示 した回路図である。

図中40は消磁用PTCサーミスタであって、カラーテレビジョン受像機におけるブラウン管の 周囲に巻かれている消磁コイル41と直列に接続され、ヒータ用PTCサーミスタ42とは両者の 間で熱伝達が行なわれるように結合(以下、熱的 に結合と表わす)されている。

PTCサーミスタは通常Ba Ti O。を主成分とする半導体セラミックスで構成され、その特性としてある温度(キュリー点)までは抵抗が低く、キュリー点以上の温度で急激に抵抗が高くなる性質をもっている。ゆえに、このPTCサーミスタに電圧を印加すると、最初は抵抗が低いので大きな電流が流れ、それにつれてPTCサーミスタ自身は自己発熱を行ない温度が上昇する。この

て、その抵抗値をますます大きくさせる。このため、消磁用PTCサーミスタ40の熱平衡状態における電流の流れは少なくなり、安定状態における磁界がより小さくなって消磁が促進される。

このように、消磁用(消磁素子部)とヒータ用 (ヒータ素子部)と2個のPTCサーミスタ 31、33より構成される消磁素子30の製造方 法は、従来消磁素子部形成用成形体とヒータ素子 部形成用成形体とを別々に焼成した後、熱的に 合させるというものであった。また、別の製造方 法として消磁素子部形成用成形体とヒータ素子 形成用成形体とを組み合せて一体的に成形の 形成用成形体とを組み合せて一体的に成形の 形成用成形体とを組み合せて一体的に成形の に焼成する方法も試みられており、この に 理数が少なくコストダウンを図る上で有利であった。

発明が解決しようとする課題

ところが上記した従来の消磁素子30の構成にあっては、1個の消磁素子30内に消磁用とヒータ用と2個のPTCサーミスタ31、33を必要とするため、消磁素子30の形状が大きくなり、

温度上昇がキュリー点にまで達すると抵抗が急激 に高くなり、電流は減少して発熱量が少なくなる ため、PTCサーミスタは熱平衡に達して安定する。

すなわち、第8図において消磁コイル41に交流電圧を印加すると、最初は抵抗が低いので消磁コイル41には大きな電流が流れ、大きな交番磁界が発生する。また、消磁用PTCサーミスタ40自身はこの流れ込んでくる大きな電流にに連すると、今度は抵抗が急激に大きくなるため流れる電流は小さくなり、それにつれて消磁コイル41において発生する磁界も小さくなって消磁が行なわれる。

また、これに同期してヒータ用PTCサーミスタ42にも電圧が印加され、ヒータ用PTCサーミスタ42自身も自己発熱を行なう。そして、このヒータ用PTCサーミスタ42の発した熱は消磁用PTCサーミスタ40に伝わり、消磁用PTCサーミスタ40の熱平衡温度の上昇を助長し

設置する際に場所を取るばかりでなく、コスト的 にも高くつくといった課題があった。

また、消磁素子3.0の従来の製造方法において、消磁素子部形成用成形体とヒータ素子部形成 用成形体とを期々に焼成した後、熱的に結合させ るという方法では、製造過程における工程数が多 く手間が掛かり過ぎるといった課題があった。

一方、上記両成形体を組み合わせて一体に成形した後、同時に焼成する方法においては、前記両成形体の成分組成が異なるため、各成形体に最適な焼成条件及び収縮率がそれぞれ異なり、割れの発生を生じ、実際上同時焼成は困難であるといった課題があった。

また、Ba Ti O。系PTCサーミス夕は、焼 成条件によって大きくその特性が変化する。特 に、低融点を有する添加物(P b 等)は、焼成中 に飛散して作成されるPTCサーミス夕の表面と 内側とにおいて組成ずれを起こす。このように、 キュリー点のシフタでもあるP b 等が飛散するこ とによって、PTCサーミスタの本来の特性に変 化が生じてしまうといった課題があった。

本発明は上記した課題に鑑み発明されたものであって、1個のPTCサーミスタに消磁機能とヒータ機能を構え、小形化が図られたPTCサーミスタの効率的な製造方法を提供することを目的としている。

課題を解決するための手段

上記した目的を達成するために本発明に係るP TCサーミスタの製造方法は、

平板部を構成する磁器素体の一部分と他の部分とがキュリー点を異にする平板形のPTCサーミスタの製造方法において、Ba Ti Os 系磁器の仮焼粉の成形体をキュリー点のシフタ元素を含む雰囲気中で焼成することを特徴とし、

また、平板部を構成する磁器素体の一部分と他の部分とが比抵抗を異にする平板形のPTCサーミスタの製造方法において、Ba Ti O: 系磁器の成形体あるいは仮焼粉の成形体をハロゲンガスの雰囲気中で焼成することを特徴としている。

作用

化合物を用いることが望ましい。

また、上記キュリー点のシフタはBaTiO。系磁器の粒内に固容して、キュリー点を移動させる動きがあり、BaTiO。系磁器の粒内に固容させる必要がある。このため、これらキュリー点のシフタの気相拡散に ひまれられば、 Cを等のハロゲン元素は粒界に偏析して、 抵抗を低下させる 所の SaTiO。系磁器の成形体に対して、 抵抗を でげる動きがあり、 BaTiO。系磁器の対象に 拡散させればよく、これらハロゲン元素の気相拡散は BaTiO。系磁器の成形体に対して行なっても構わない。

このように、気相拡散作用を起こさせる元素の 種類に応じて製造方法を選択することにより、前 記作用が十分に発揮される。

ところで、前記元素を気相拡散させて焼成を行なう場合には、Ba Ti O。系磁器の成形体あるいは仮焼粉の成形体(試料成形体)の形状についても考慮する必要がある。

上記したPTCサーミスタの製造方法にあっては、BaTiO』系磁器の仮焼粉の成形体をキュリー点のシフタであるPb等の雰囲気中で焼成するか、あるいはBaTiO』系磁器の成形体を抵抗値を低下させるF、Cを等のハロゲンガスの雰囲気中で焼成することによっての表面より浸透する。このためは、得られるPTCサーミスタの表層部と中心が異なったものでは、消避素子部及びヒータ素子部ないものでは、消避素子部及びヒータ素子の強強素子の強強を強いしていている。となる。なり、消避素子の強性が異なったの、従来からの課題であったPTCサーミスタの組成すれ現象を逆に利用して優れた特性のPTCサーミスタが得られる。

ここで、気相拡散させる元素のうちキュリー点のシフタであるPb、Sr、Zr、Ca等の化合物は一般的に気化しにくいため、容易に気化させるにはPbは酸化物のような形態の化合物を用い、Sr、Zr、Ca等は塩化物のような形態の

例えば、第4図(a)に示したような円板形状のPTCサーミスタ用磁器素体を作成しようとする場合、初めから円板形状に形成された試料成形体間の各隙間からも気相拡散によってPb等拡散元素が侵入し、試料成形体の中心側の電極構成面にまでこれら元素が浸透してしまう。このため、得られる磁器素体の表面に第4図(b)に示したように中心側の電極を構成するには、表面を研磨する必要が生じる。

そこで、まずは円柱状に形成した試料成形体を 気相拡散元素の雰囲気中で焼成し、その後円板形 状に切り出すことにより、表面研磨という工程を 経ることなく求めるPTCサーミスタ用の磁器素 体が作成される。

このようにして得られた磁器素体において、前記元素が気相拡散した外周部分をヒータ用とし、 他方、中心部分を消磁用として用いることにより、1個のPTCサーミスタに2つの機能特性を 持たせられ、消磁用部分における熱平衡温度の上 昇を助長して、熱平衡状態における電流の流れを 少なくすることによって、消避はより促進され る。

実施例と比較例

以下本発明に係るPTCサーミスタの製造方法の一実施例を図面に基づいて説明する。なお従来例と同一機能を有する構成部品には同一の符合を付すこととする。

第1図において10は、焼成に必要な酸素を供給することができかつ、気相拡散元素の雰囲気も維持できるようになっている準密閉容器(大気の出入りも起こる)で、マグネシア製板材11とマグネシア製ケース12(擬が40cm、構が40cm、高さ10cmである。)とにより構成されている。この準密閉容器10中に、円柱形状の試料成形体13を数個載置して焼成準備を行なう。

まず、気相拡散元素としてキュリー点のシフタ であるPbを用いる場合について説明する。

P b は酸化物としての形態を有する化合物が気化し易いので、準密閉容器 1 0 中に試料成形体

第2図は、PTCサーミスタ20の断面図を示したもので、円板形状の基板19の片面には、輪状電極21と円形の電極22が形成され、他の片面には略全面にわたり円形の電極23が形成されている。そして、電極21にはリード端子26が、電極22にはリード端子24が、また、電極23にはリード端子25がそれぞれ接続されており、これら基板19、電極21、22、23及びリード端子24、25、26は樹脂層27で被覆され保護絶縁されている。

上記構成のPTCサーミスタ20において、基板19の外周部に形成されたヒータ素子部19aと中心部に形成された消磁素子部19bとでは、そのキュリー点あるいは比抵抗が異なる。

第3図は、上記PTCサーミスタ20の寸法の具体例を示したものである。基板19の厚さTは約2mm、 直径Dは約22mm、電極21の幅Wは約3mm、電極22の直径 d は約14mm程度に設定されており、電極21と電極22との間隔は1mm 程度が確保されている。

13と共にPb酸化物14の一定量を載置する。 そして、前記両者を同時に焼成することにより、 試料成形体13は気化したPbの雰囲気中で焼成 がなされる。ただし、用いるPb酸化物14の量 は、用意した試料成形体13の量に応じて設定する。

他方、比抵抗を低下させるF、C & 等のハロゲン元素を用いる場合には、これらハロゲン元素はもともとガス体であるのでこのガス体のまま準密閉容器 1 0 中に導入し、ハロゲンガスの雰囲気中で試料成形体 1 3 を焼成する。

次に、上記気相拡散元素の雰囲気中で焼成された円柱形状の試料成形体13を、第4図(a)に示したように円板形状に切り出し、その後第4図(b)に示したように円板形状の磁器素体(以下、基板と記す)19の表裏両面に電極21、22、23を形成する。そして、リード端子24、25、26をそれぞれ電極22、23、21に接続した後、樹脂層27で被獲してPTCサーミスク20を作製した(第2図)。

このような構成のPTCサーミスタ20の成分 組成は、一般に、Ba Ti O』とSrTiO』と より成る主成分 100mc ℓ に対して、半導体化剤と してDy』O』が $0.02 \sim 0.5mc$ ℓ 、焼結助剤 としてTiO』、SiO』のうち少なくとも一種 類が $0.1 \sim 5.0mc$ ℓ 、PTC効果向上剤としてM n Oが $0 \sim 1.0mc$ ℓ の各範囲で含有されている。

以下に説明する実施例1、2において、試料成形体の成分組成は下記の第1表によった。そして、上記製造方法に従いPTCサーミスタ20を作製した後、それぞれの抵抗ー温度特性を調べた。

尚、以下に説明する第5図、第6図中における R、はリード端子24、25の間の比抵抗を示し ており、R。はリード端子25、26の間の比抵 抗を示している。また、試料を大気雰囲気中で焼 成した場合を比較例とした。

第 1 表

	成 分 継 成 (mo.2)							
	BaTiO,	SrTiO.	Dy. 0.	TiO.	\$10.	MnO.		
医块粉 ①	80	20	0.15	4.0	1. 0	0. 08		
仮焼粉②	80	20	0. 15	1. 0	1. 0	0. 08		

第 2 表

	Ts (°C)	a	*	平衡点制流 { R _z }	常濃抵抗罐R。 (Ω)
実施例 1					
R,	55	18	6	6mA	5
R.	67	16	5		7
実施例2			-		
R.	55	18	6	7 mA	5
Ra	55	16	5		3
比较例					
R.	55	18	6	5 O=A	5

但し、TS:キュリー点の温度

α :温度-抵抗曲線の傾き量大抵抗値

サ :80g 最小抵抗値

<実施例1>

第1表に示した仮焼粉①を用いて、直径が27mm、高さが8cm の円柱状成形体13を作成し、準密閉容器10中に前記成形体13を10個とPb酸化物14であるPb。0、100gとを載置して1320℃で約2時間焼成した。そして、上記方法により成形体13を約2mm の厚さにカットするとともに電極を形成してPTCサーミスタ20を作製した。

第5 図は、上記実施例1 で得られた P T C サーミスク2 0 の有する抵抗 - 温度特性を示したものである。このグラフより明らかなように、 R * は R * より高いキュリー点を有する。これは、 基板 1 9 の外周部(ヒータ素子部 1 9 a)にはキュリー点のシフタである P b が含有され、 P b の粒内 拡散の影響を受けるためである。

従って、第8図に示したような消磁回路を設計 した場合には、キュリー点の高いヒータ素子部 19aはキュリー点の低い消磁素子部19b(中 心部)に対してヒータ的作用を及ぼす。このた め、消磁素子部は単体で存在した時よりも高温に 維持されその平衡点電流が小さくなるため、消磁 がさらに促進される。

<実施例2>

第1表に示した仮焼粉②を用いて、直径が27mm、高さが8cm の円柱状成形体13を作成し、準密閉容器10中に前記成形体13を16個載置してハロゲン化合物ガスであるCCℓ 4 ガスを20 mℓ/min の流量で導入しながら1320℃で約2時間焼成した。上記方法により円柱状成形体13を約2mm の厚さにカットするとともに電極を形成してPTCサーミスタ20を作製した。

第6図は、上記実施例2で得られたPTCサーミスタ20の有する抵抗ー温度特性を示したものである。このグラフより明らかなように、R. はR. より小さな比抵抗を有す。これは、基板19の外側部(ヒータ素子部19b)にはC&が含有され、C&の粒界拡散の影響を受けるためである。

従って、第8図に示したような消磁回路を設計

特開平3-246902(6)

した場合には、比抵抗の小さいヒータ素子部 19 a は消磁素子部19 b に対してヒータ的な作 用を及ぼす。このため、消磁素子部19 b は単体 で存在した時よりも高温に維持されその平衡点電 流が小さくなるため、消磁がさらに促進される。

上記実施例1、2についての結果を数値で表わ すと上記の第2表に示したようになった。

また、仮焼粉①を用いて成形体13を形成し、 この成形体13の焼成を行なう雰囲気を大気中と したものを比較例として記載した。

このように、PTCサーミスタ20の製造方法において、Ba Ti O。系磁器の仮焼粉の成形体を、キュリー点のシフタであるPb等あるいはBa Ti O。系磁器の成形体あるいは仮焼粉の成形体を比抵抗を低下させるF、C 2 等のハロゲン元素を含む雰囲気中で焼成することにより、キュリー点あるいは比抵抗特性を異ならしめることができる。

すなわち、PTCサーミスタ20内に消磁用と ヒータ用と2個のPTCサーミスタを設置しなく

素の種類によっては拡散濃度を種々検討して用い ることが望ましい。

発明の効果

以上の説明により明らかなように、本発明に係る平板形PTCサーミスタの製造方法にあっては、Ba Ti O。系磁器の仮焼粉の成形体をキュリー点のシフタ元素を含む雰囲気中で焼成することにより、平板部を構成する磁器素体の一部分とにおいて、そのキュリー点を異にするPTCサーミスタを前記磁器素体に割れ等を発生させることなく容易に製造することができる。

また、Ba Ti O。系磁器の成形体あるいは仮 焼粉の成形体をハロゲン元素の雰囲気中で焼成す ることにより、平板部を構成する磁器素体の一部 分と他の部分とにおいて、その比抵抗を異にする PTCサーミスタを前記磁器素体に割れ等を発生 させることなく容易に製造することができる。

したがって、上記方法により製造されたPTCサーミスタにあってはPTCサーミスタ内に消破用とヒータ用と2個のPTCサーミスタを設置し

ても、1つのPTCサーミスタ20内に消磁機能とヒータ機能を持たせることが磁器基板に割れの発生を生じさせずに可能となる。そして、このように製造されたPTCサーミスタ20ではヒータ素子部19aの働きにより、消磁素子部19bにおける熱平衡温度を高温に維持することができまり小さくによって、熱いできる。また、形状的にもコンパクト化を図ることができかつコスト的にも安く生産することが可能となる。

このように、本発明に係るPTCサーミスタの製造方法では、従来の2個のPTCサーミスタを設置する製造方法に比べ、製造過程における工程数が少なくなり作業の簡素化を図ることができ、かつコストダウンを図ることができる。

尚、本発明は上記実施例に限定されることはなく、要旨を逸脱しない範囲において変更可能である。たとえば、焼成中の気相拡散元素による雰囲気調整において、望むPTC特性あるいは拡散元

なくても、消磁機能とヒータ機能を1つのPTC サーミスタに持たせることができる。そして、ヒ ータ素子部の動きにより、消磁素子部における熱 平衡温度を高温に維持でき、平衡点電流をより小 さくすることによって、熱平衡状態における消磁 電流の制御を効率的に行なうことができ、消磁を より促進させることができる。

また、形状的にもコンパクト化が図られたPT Cサーミスタを製造することができかつ、コスト 的にも安く生産することが可能となる。

このように、本発明に係るPTCサーミスタの製造方法を用いれば、1つのPTCサーミスタに複数の機能を持たせられながら従来の製造方法に比べ、製造通程における工程数を少なくして作業の簡素化を図ることができ、また、コストダウンを図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

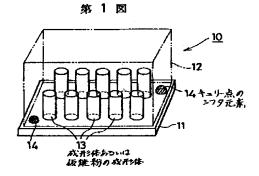
第1図は本発明に係るPTCサーミスタの製造 方法を説明するための科視図、第2図は本発明に 係る方法により製造されたPTCサーミスタの一

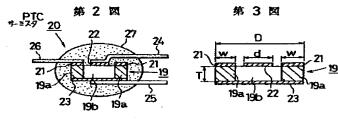
特開平3-246902(7)

例を示す断面図、第3図は製造されたPTCサーミスタの寸法例を示す断面図、第4図は本発明に係るPTCサーミスタの製造方法を説明するための斜視図、第5図、第6図は本発明に係る方法により製造されたPTCサーミスタの抵抗ー温度特性を示すグラフ、第7図は従来の消磁素子を示す断面図、第8図は消磁素子を使用した回路図である。

- 13 … Ba Ti O a 系磁器の成形体 あるいは仮焼粉の成形体
- 14 --- P b 酸化物(キュリー点の シフタ元素化合物)
- 20 … P T C サーミスタ

特 許 出 願 人:住友金属工業株式会社 代 理 人:弁理士 井内 龍二





第 4 図 (b) 22 21 -19 23

